

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年12月5日(2022.12.5)

【公開番号】特開2022-109271(P2022-109271A)

【公開日】令和4年7月27日(2022.7.27)

【年通号数】公開公報(特許)2022-136

【出願番号】特願2022-70977(P2022-70977)

【国際特許分類】

H 01 L 21/677(2006.01)

10

B 65 G 49/07(2006.01)

H 01 L 21/027(2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 A

B 65 G 49/07 C

H 01 L 21/30 562

【手続補正書】

【提出日】令和4年11月24日(2022.11.24)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板が格納される搬送容器を載置するステージと、

前記基板に対して処理を行う処理部と、

前記処理部に対して前記基板を受け渡すために設けられ、前記処理部による処理前の基板、処理後の基板の各々が載置される受け渡しモジュールと、

前記基板を搬入出すための搬送口を有し、前記処理部による処理前あるいは処理後の前記基板を検査する複数の検査モジュールと、

前記ステージに載置される前記各搬送容器と、前記受け渡しモジュールと、前記複数の検査モジュールと、の間に基板を搬送する基板搬送機構と、

前記基板搬送機構による前記基板の搬送領域を囲む筐体と、

を備え、

前記搬送口は前記搬送領域に開口し、前記筐体の外部において前記複数の検査モジュールが左右方向に並ぶことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

複数の前記ステージと、複数の前記検査モジュールとが、上下方向に並ぶことを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

40

【請求項3】

前記筐体内において前記基板搬送機構が前記受け渡しモジュールとの間に受け渡しを行う位置は、平面視で左右に並ぶ2つの前記検査モジュールの搬送口の間に位置することを特徴とする請求項1または2記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記複数の検査モジュールの少なくとも一部は前記筐体から突出し、

当該複数の検査モジュールは、前記基板処理装置に対して着脱自在であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか一つに記載の基板処理装置。

【請求項5】

50

異なる高さで前記検査モジュールが左右方向に並ぶことで、当該検査モジュールは上下方向においても並ぶことを特徴とする請求項 1ないし4のいずれか一つに記載の基板処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明の基板処理装置は、基板が格納される搬送容器を載置するステージと、
前記基板に対して処理を行う処理部と、

前記処理部に対して前記基板を受け渡すために設けられ、前記処理部による処理前の基板
、処理後の基板の各々が載置される受け渡しモジュールと、

前記基板を搬入出するための搬送口を有し、前記処理部による処理前あるいは処理後の前記基板を検査する複数の検査モジュールと、

前記ステージに載置される前記各搬送容器と、前記受け渡しモジュールと、前記複数の検査モジュールと、の間で基板を搬送する基板搬送機構と、

前記基板搬送機構による前記基板の搬送領域を囲む筐体と、
を備え、

前記搬送口は前記搬送領域に開口し、前記筐体の外部において前記複数の検査モジュール
が左右方向に並ぶことを特徴とする

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【補正の内容】

10

20

30

40

50